(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2002年4月4日 (04.04.2002)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 02/27305 A1

(51) 国際特許分類[7]: G01N 21/956, H01L 21/66

(21) 国際出願番号: PCT/JP01/08295

(22) 国際出願日: 2001年9月25日 (25.09.2001)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2000-292938 2000年9月26日 (26.09.2000) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): オリンパス光学工業株式会社 (OLYMPUS OPTICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 太田佳成 (OTA, Yoshinari) [JP/JP]; 〒399-0428 長野県上伊那郡辰野町大字伊那富8686 オリンパス辰野寮452号 Nagano (JP).

(74) 代理人: 鈴江武彦, 外(SUZUYE, Takehiko et al.); 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目7番2号 鈴榮内外國特許法律事務所内 Tokyo (JP).

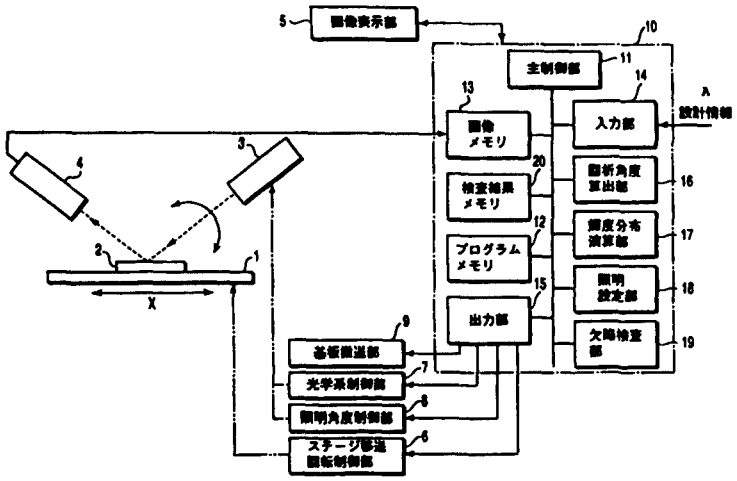
(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[続葉有]

(54) Title: FLAW DETECTING DEVICE AND COMPUTER-READABLE STORAGE MEDIUM

(54) 発明の名称: 欠陥検出装置及びコンピュータにより読み取り可能な記憶媒体



5...IMAGE DISPLAY UNIT
6...STAGE TRANSFER/ROTATION CONTROL UNIT
7...OPTICAL SYSTEM CONTROL UNIT
8...ILLUMINATING ANGLE CONTROL UNIT
9...SUBSTRATE CONVEYING UNIT
11...MAIN CONTROL UNIT
A...DESIGN INFORMATION
12...PROGRAM MEMORY
13...IMAGE MEMORY
14...INPUT UNIT
15...OUTPUT UNIT
16...DIFFRACTION ANGLE CALCULATING UNIT
17...BRIGHTNESS DISTRIBUTION COMPUTATING UNIT
18...ILLUMINATION SETTING UNIT
19...FLAW DETECTING UNIT
20...INSPECTION RESULT MEMORY

(57) Abstract: A flaw detecting device which comprises an illuminating unit for applying an illuminating light to an inspection object and an imaging unit for imaging a diffracted light from the inspection object, and which inspects the inspection object for any flaw from image data imaged by the imaging unit, wherein the device further comprises a diffraction angle calculating unit for determining, based

[続葉有]

WO 02/27305 A1

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

on design information of the inspection object, a diffraction angle, with respect to the inspection object, of the illuminating light optimum for imaging the diffracted light, and an illumination setting unit for setting the incident angle of the illuminating unit to the diffraction angle calculated by the diffraction angle calculating unit.

(57) 要約:

本発明の欠陥検出装置は、検査対象に対して照明光を照射する照明部と、前記検査対象からの回折光を撮像する撮像部とを備え、前記撮像部により撮像された画像データから前記検査対象の欠陥検査を行う欠陥検出装置において、前記検査対象の設計情報に基づいて、前記回折光を撮像するのに最適な前記照明光の前記検査対象に対する回折角度を求める回折角度算出部と、この回折角度算出部により算出された前記回折角度に前記照明部の入射角度を設定する照明設定部と、を具備している。